

연속다공질 SiC-Si₃N₄ 복합체의 미세구조 및 기계적 특성

Rajat Kanti Paul · Asit Kumar Gain · 이희정 · 장희동* · 이병택†

공주대학교 신소재공학부
한국지질자원연구원 자원환경소재연구부

Microstructure Control and Mechanical Properties of Continuously Porous SiC-Si₃N₄ Composites

Rajat Kanti Paul, Asit Kumar Gain, Hee-Jung Lee, Hee-Dong Jang and Byong-Taek Lee†

School of Advanced Materials Engineering, Kongju National University
Korea Institute of Geoscience & Mineral Resources (KIGAM)

(2006년 1월 11일 접수, 2006년 3월 8일 최종수정문 접수)

Abstract The microstructures and mechanical properties of continuously porous SiC-Si₃N₄ composites fabricated by multi-pass extrusion were investigated at different Si levels added. Si-powder with different weight percentages (0%, 5%, 10%, 15%, 20%) was added to the SiC powder to make the raw mixture powders, with 6wt%Y₂O₃-2wt%Al₂O₃ as sintering additives, carbon (10-15 μm) as a pore-forming agent, ethylene vinyl acetate as a binder and stearic acid (CH₃(CH₂)₁₆COOH) as a lubricant. In the continuously porous SiC-Si₃N₄ composites, Si₃N₄ whiskers like the hairs of nostrils were frequently observed on the wall of the pores. In this study, the morphology of the Si₃N₄ whiskers was investigated with the silicon addition content. In the composites containing of 10 wt% Si, a large number of Si₃N₄ whiskers was found at the continuous pore regions. In the sample to which 15 wt% Si powder was added, maximum values of about 101 MPa bending strength and 57.5% relative density were obtained.

Key words SiC-Si₃N₄ composite, Si₃N₄ whisker, Porous body.

1. 서 론

비노체 산업에서 발생하는 폐 Si 슬러지의 재활용을 통해 고부가가치의 세라믹 소재를 얻고자 비용소진 (RBSN) 세라믹의 제조 공정에 관한 연구가 주목되어 왔다.¹⁻³⁾ 그러나 최근 Si 웨이퍼 제조를 위한 잉곳의 전사 방법으로 기존에 이용되었던 다이아몬드 휠 전사 공정이 최근에는 Si 손상의 가능성이 Si 웨이퍼의 생산량을 보다 증가시키기 위해 와이어 전사 공정으로 대체되고 있는 추세이다. 이 공정의 경우 Si 잉곳의 전사 과정에서 미세한 SiC 및 Si 입자들은 전사능을 떨어뜨리기 때문에 재생 공정에서 다량의 SiC가 함유된 슬러지가 발생한다. 이를 SiC 슬러지는 바탕의 실리콘과 전사와이어의 마모 손상에 의한 소량의 Fe 성분을 함유하며, Al, Ca, Cr, P, S 와 같은 기타 불순물을 소량 함유한다.⁴⁾ 이러한 폐 SiC 슬러지를 이용하여, 공기나 수진 정화를 위한 환경필터에 응용하기 위해 RBSN 세라믹 뿐만 아니라 연속다공질 SiC-Si₃N₄ 복합체의 제조가 가능할 것으로 기대된다.^{4,5)} 일

반적으로 Si₃N₄ 위스커는 VS(vapor-solid)와 VLS(Vapor-liquid-solid) 베크너즘에 의해 생성된다. Si₃N₄ 위스커는 1000~1100°C의 저온에서는 VS 베크너즘에 의해 형성되며, 1200°C 이상의 온도에서는 VLS 베크너즘에 의해 형성된다고 알려져 있다.^{6,8)} 폐 SiC 분말에는 SiO₂가 다양 존재하기 때문에 상용의 Si 분말에 비하여 Si의 진화율은 상대적으로 낮다.²⁾ 그러나 폐 SiC 슬러지에 존재하는 SiO₂와 Fe 입자들은 VLS(vapor-solid-liquid) 베크너즘을 통한 Si₃N₄ 위스커의 제조에 매우 유리하다.^{6,8)} Si₃N₄ 및 SiC는 매우 강한 공유결합으로 이루어져 있기 때문에 소금조제의 철가 없이는 소결이 불가능하다. 이들의 소결 조제로는 MgO, Al₂O₃, Y₂O₃ 와 같은 비산화물 세라믹과 피로우 산화물 또는 그들의 조합인 조성이 일반적으로 사용된다. 이중에서 Al₂O₃와 Y₂O₃는 Si₃N₄의 치밀화에 매우 우수한 효과를 나타낸다.^{9,10)}

본 연구에서는 다중압출공정을 이용하여 연속다공질 SiC-Si₃N₄ 복합체를 제조하였다. 연속기공에서 혼히 관찰되는 Si₃N₄ 위스커는 여과 절차를 높여 필터 재료로 매우 유용할 수 있기 때문에 전화분위기에서 실리콘의 철가량 변화에 따른 위스커의 형성에 관해 고찰하였다.

*E-Mail : lbt@kongju.ac.kr

2. 실험 방법

Fig. 1은 본 실험의 개략도를 나타낸것이다. 폐 SiC 슬러지는 유기물의 제거를 위해 아세톤에서 세척 후, hot plate에서 교반시키며 건조하였다. 폐 SiC 분말, 평균 입도 7 μm인 분말(H. Starck, 0-20 wt%)과 소결조제로 6 wt% Y₂O₃ (Daejung Chemicals & Metal Co., Korea) 2 wt% Al₂O₃(Sumitomo Chemical Co., Japan)를 Si₃N₄ 볼을 사용하여 에탄올에서 볼밀을 통해 혼합 후 건조하였다. 건조된 이들 혼합분말에 ethylene vinyl acetate (ELVAX 210 and ELVAX 250, Dupont, USA)와 stearic acid (CH₃(CH₂)₁₆COOH, Daejung Chemicals & Metals Co., Korea) 고분자를 부피분율 50:40:10이 되도록 혼합하였다. 전단믹서에서 120°C의 온도로 30분간 혼합하여 균일해진 혼합물을 warm press 공정에 의해 연속기공의 프레임이 될 튜브를 압출하였다. 또한 기공 형성부를 위해 기공형성제인 탄소 분말, 고분자 및 stearic acid를 각각 50:40:10의 부피비율이 되도록 혼합하여 상기튜브의 제조방법과 동일한 제조법으로 봉상을 압출하였다.¹¹⁾ 이들 튜브와 봉을 서로 합체하여 3.5 mm의 필라멘트로 1회 압출하였으며,^{12,13)} 1회 압출된 필라멘트는 core-shell 구조로 이루어진다. 2회 압출 필라멘트는 1회 압출 필라멘트 끝음을 재압출하여 얻어지게된다. 이들 압출재를 700°C의 N₂ gas 분위기에서 탈지처리하여 유기결합제를 제거하였다. 연속다공질 SiC-Si₃N₄ 복합체를 제조하기 위해 1400°C의 N₂+10% H₂ 혼합가스 분위기에서 20시간동안 질화반응 시켰다. 이들 질화물은 XRD분석(D/MAX-250, Rigaku, Japan)을 통하여 결정구조 분석을 수행하였으며, SEM(JSM-635F, Jeol)을 사용하여 미세구조, 기공 및 연속기공 내에 분포하고 있는 Si₃N₄ 위스커를 관찰하였다. 또한 Si₃N₄ 위스커를 TEM(JEOL-2010, JEOL)을 이용하여 분석하였다. 질화물의 상태밀도는 Archimedes 방법을 사용하여 측정하였고, 곡강도는 만능시험기(UnitechTM, R&B Co., Korea)를 사용하여 측정하였다.

3. 결과 및 고찰

Fig. 2는 SiC-Si₃N₄ 복합체 제조를 위해 초기재료로 사용한 폐 SiC와 Si 분말의 SEM 이미지와 EDS 분석 결과이다. SiC 분말은 약 7 μm의 불규칙한 형상으로 이루어져있으며, SiC 입자의 표면에는 단결정 Si 잉곳의 와이어 절삭공정 중 부착된 것으로 보이는 약 2 μm 크기의 미세한 Si 입자들이 관찰되었다. EDS 분석결과 (c) Si 잉곳의 와이어 절삭 공정 중 와이어의 마모로 인해 폐 SiC 슬러지에 소량의 Fe 피크가 검출되었다. 폐 SiC 슬러지에 존재하는 SiO₂와 Fe 입자들은 VLS(vapor-solid-liquid) 메커니즘을 통한 Si₃N₄ 위스커의 제조에는 매우 유리하다.⁶⁻⁸⁾ 본 연구에서 사용된 폐 SiC 분말에 불순물로 소량 존재하는 Fe가 Si₃N₄ 위스커의 형성에 촉매로 작용할 수 있다.⁴⁾ Fig. 2(d)는 연속다공질 SiC-Si₃N₄ 복합체 제조를 위해 폐 SiC 분말에 다양한 조성비로 첨가된 Si 분말의 SEM 이미지이다. Si 분말의 입자 크기는 SiC와 거의 유사한 약 7 μm로 나타났다.

Fig. 3의 (a)는 소결조제가 첨가된 SiC-20wt%Si 혼합분말의 XRD 분석 결과이고, (b)는 압출재의 1차 탈지후, (c)는 2차 탈지 후의 압출재, 그리고 (d)는 2차 탈지후 1400°C에서 질화처리한 압출재의 XRD 분석결과이다.

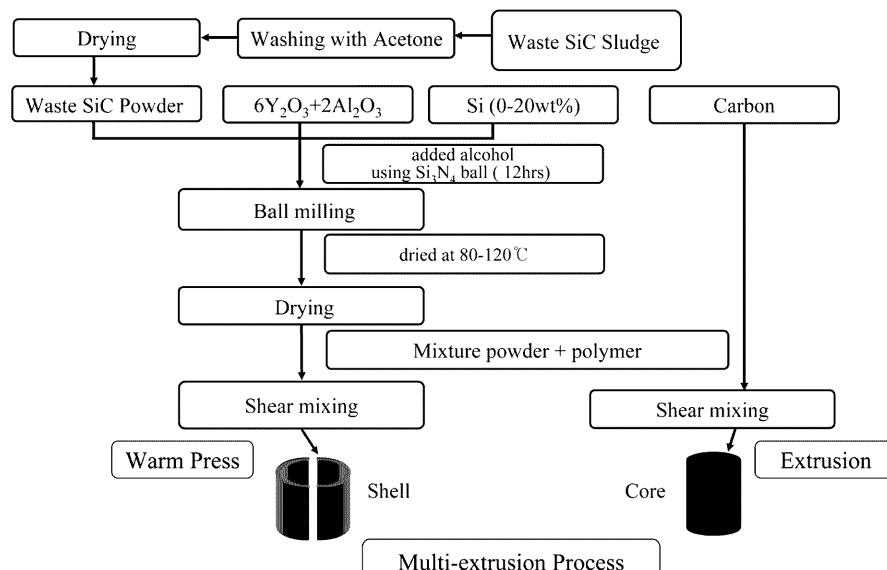


Fig. 1. A schematic flow diagram of experimental procedures.

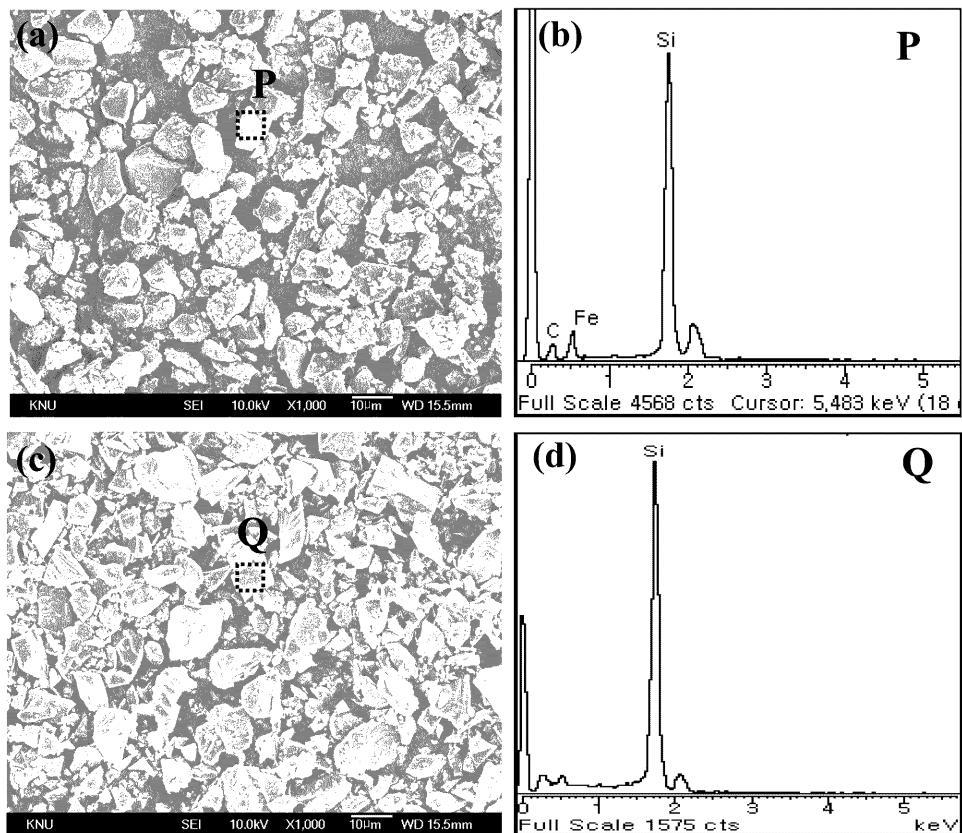


Fig. 2. Low magnification SEM images, images and EDS profiles of SiC (a,b) and Si (c, d) powders, respectively.

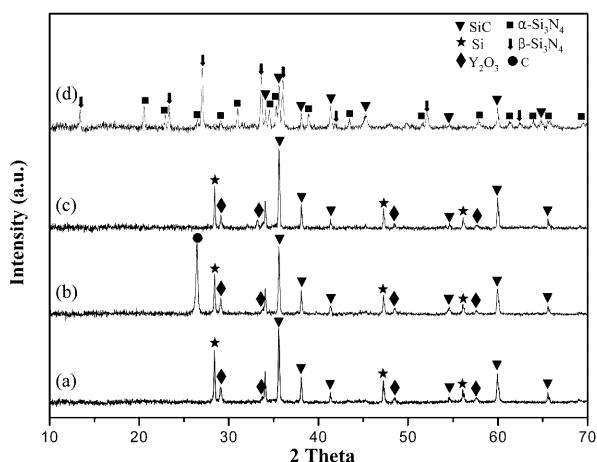


Fig. 3. XRD profiles of (a) waste SiC-20wt% Si powder including sintering additives, (b) after 1st burning-out, (c) after 2nd burning-out and (d) after nitridation of extruded bodies.

700°C에서 1차 탈지 후 다른 상변화는 관찰되지 않았으며, 기공형성제로 첨가된 탄소가 검출되었다. 그러나 1000°C에서 2차 탈지 후에는 탄소가 대부분 제거되어 탄소 피크가 관찰되지 않고 있다. 질화공정 이후에는 SiC 상과 함께 α -Si₃N₄과 β -Si₃N₄ 상이 나타났다. 그러나 탈

지 후에도 Y₂O₃ 피크가 검출되지만 1400°C에서 질화반응후에는 이들 소결조제가(6wt%Y₂O₃-2wt%Al₂O₃) 용해되어 비정질상으로 존재하기 때문에 XRD 분석에서는 나타나지 않았다. 질화 공정 동안 Si 상은 균열과 전위의 형성에 의해 질화가 촉진되어 Si₃N₄로 용이하게 상전이 된다.^{14,15)} 질화 이후에 Si 상이 검출되지 않는 것으로 보아 Si 분말은 완전히 질화 되어 α -Si₃N₄과 β -Si₃N₄ 상으로 상전이 된 것으로 판단된다.

Fig. 4는 Si 첨가량에 따라 N₂ gas 분위기에서 질화공정을 거친 SiC-Si₃N₄ 복합체의 SEM 미세조직이다. Fig. 4(a)는 Si 분말이 첨가되지 않은 복합체의 다공질체를 보여주고 있으며, 매우 적은 양의 Si₃N₄ 위스커가 관찰되었다. 그러나 10%의 Si 분말을 첨가한 복합체의 경우 약 0.98 μm 직경의 많은 Si₃N₄ 위스커들이 기공내에 균일하게 분포되어 있었다. 15%와 20%의 Si 분말을 첨가한 복합체 역시 기공내에서 Si₃N₄ 위스커들이 관찰되었으나, 이들 Si₃N₄ 위스커의 평균 직경은 각각 1 μm에서 1.49 μm로 증가하는 경향을 보였다.

Fig. 5는 10wt%의 Si 분말이 첨가된 다공질 SiC-Si₃N₄ 복합체의 길이는 70 mm, 직경 3.5 mm인 시편을 이용하여 소결체의 위치에 따른 Si₃N₄ 위스커의 형성 정도를 조사하기 위해 SEM 관찰을 한 결과이다. Fig. 6의 조

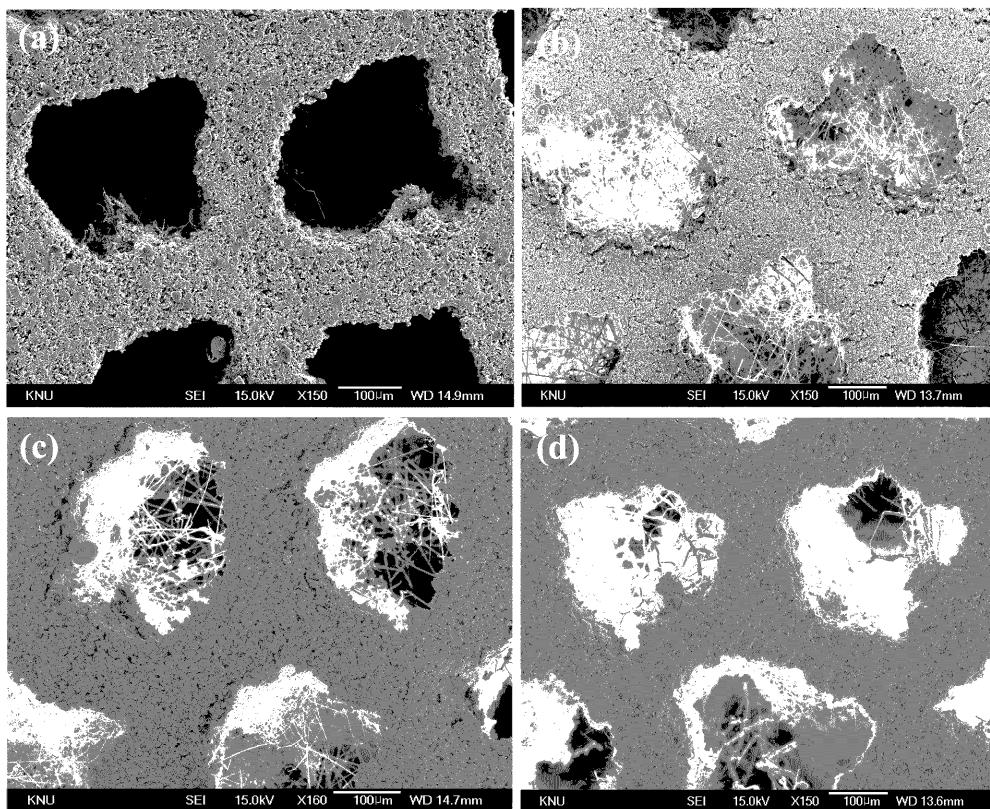


Fig. 4. SEM micrographs of 2nd passed continuously porous SiC-Si₃N₄ composites depending on (a) 0wt%, (b) 10wt%, (c) 15wt% and (d) 20wt% Si addition content using N₂ gas as nitridation atmosphere.

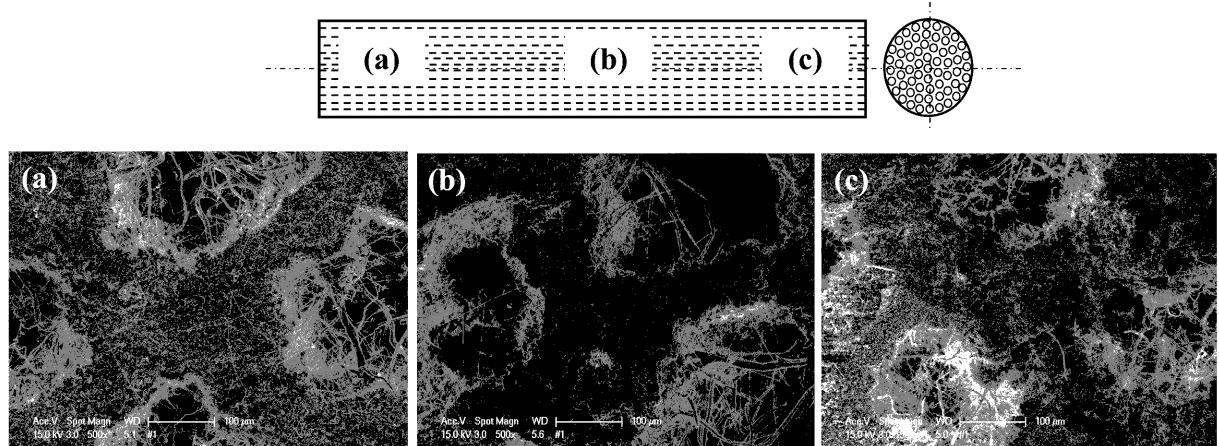


Fig. 5. SEM images of end (a,c) and middle (b) regions of the 2nd passed filament of 10wt% Si addition content continuously porous SiC-Si₃N₄ composite.

직사진 위쪽에 시편 모식도로 나타낸 봐와 같이 SEM 조작 (a), (b) 및 (c)는 각각 모식도의 (a), (b) 및 (c) 영역에서 채취한 시편의 조직이다. 이들의 관찰 결과로부터 연속다공을 갖는 SiC-Si₃N₄ 다공질 소결체내에 분포하고 있는 Si₃N₄ 위스커는 비교적 균일하게 분포하고 있음을 알 수 있다.

Fig. 6은 연속다공질 SiC-Si₃N₄ 복합체 내에 존재하는 Si₃N₄ 위스커의 결정성 여부를 확인하기 위해 수행한 TEM 관찰결과이다. (a)의 P 영역에서 얻은 전자선 회절패턴과 EDS 분석 결과로부터 이들 위스커는 단결정 Si₃N₄ 상임을 알 수 있다.

Table 1은 폐SiC 분말에 Si 분말의 첨가에 따른 연속

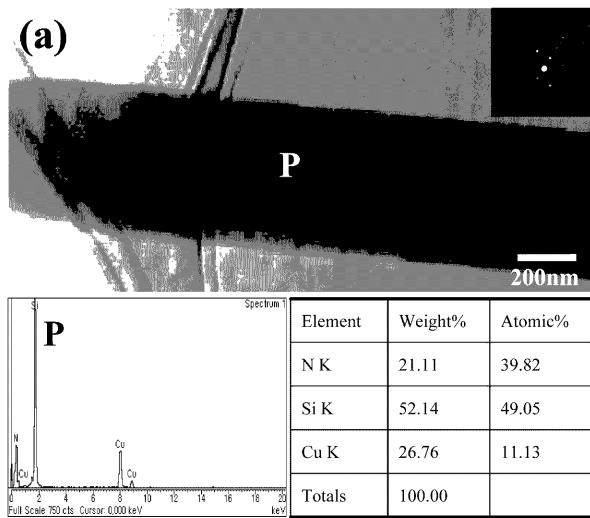


Fig. 6. TEM image of the Si_3N_4 whisker of the continuously porous $\text{SiC-Si}_3\text{N}_4$ composites.

Table 1. Relative density and bending strength of continuously porous $\text{SiC-Si}_3\text{N}_4$ composites depending on the Si addition content.

Sample	Bending Strength (MPa)	Relative density (%)
SiC-0 wt%Si	45.05±3.12	50.4
SiC-5 wt%Si	63.45±2.15	53.7
SiC-10 wt%Si	73.32±5.27	56.7
SiC-15 wt%Si	101.04±3.87	57.5
SiC-20 wt%Si	97.43±7.32	56.7

다공질 $\text{SiC-Si}_3\text{N}_4$ 복합체의 상대밀도와 곡강도를 나타내었다. Si 분말의 첨가량에 따라 반응소결 Si_3N_4 의 생성으로 인해 곡강도 값 뿐만 아니라 상대밀도도 증가하는 경향을 보였다. 특히 15 wt%의 Si 분말이 첨가된 다공질 복합체에서 101 MPa의 가장 큰 곡강도와 57.5%의 상대밀도 값을 나타내었다.

4. 결 론

폐 SiC 분말을 사용하여 다중압출공정에 의해 연속다공질 $\text{SiC-Si}_3\text{N}_4$ 복합체를 제조하였다. 연속다공질 내부에는

다수의 Si_3N_4 위스커가 관찰되었으며 이는 SiC 분말에 존재하는 Fe 불순물이 촉매로서 작용하여 VLS 메커니즘에 의해 위스커의 형성을 촉진시킨 결과로 판단된다. 한편, 첨가된 Si 분말의 함량이 증가 할 수록 Si_3N_4 위스커의 직경은 증가하는 경향을 보였으며, 전자선 회절 패턴과 EDS 분석결과 단결정 Si_3N_4 위스커임이 확인되었다. 또한 Si 분말 함량의 증가는 반응결합을 유도하는 Si_3N_4 상의 함량을 증가시키기 때문에 $\text{SiC-Si}_3\text{N}_4$ 다공질 소결체의 상대밀도 및 곡강도 값을 증가시키는 경향을 보여, 15 wt% SiC 가 첨가된 경우 곡강도 값은 약 101 MPa를 보였다.

감사의 글

본 연구는 21C 프론티어 사업, 산업폐기물재활용기술개발 사업단의 연구비 지원하에 수행되었으며, 이에 감사드립니다.

참 고 문 헌

1. B. T. Lee, D. H. Jang and T. S. Kim, *J. Eur. Ceram. Soc.*, **24**, 2313 (2004).
2. B. T. Lee, H. G. Jeong and K. Hiraga, *Mater. Trans.,JIM*, **43**, 19 (2002).
3. S. Y. Lee and B. T. Lee, *Ceram. Trans.*, **93**, 51 (1998).
4. A. K. Gain, J. K. Han, H. D. Jang and B.T. Lee, *J. Eur. Ceram. Soc.*, (2005) in press.
5. N. Miyakawa, H. Sato, H. Maeno and H. Takahashi, *JSME Review*, **24**, 269 (2003).
6. P. C. Silva and J. L. Figueiredo, *Mater. Chem. Phys.*, **72**, 326 (2001).
7. C. Kawai and A. Yamakawa, *Ceram. Int.*, **24**, 135 (1998).
8. N. Gao, K. Watari, S. Kume, Y. Ando, S. Ryo and H. Itoh, *J. Eur. Ceram. Soc.*, **26**, 837 (2006).
9. P. M. Farries, E. Bullock and R. D. Rawlings, *J. Mater. Sci. Lett.*, **18**, 1727-1730 (1999).
10. Y. Zhang, *Mater. Res. Bull.*, **39**, 401 (2004).
11. B. T. Lee and I. C. Kang, *J. Am. Ceram. Soc.*, **88**, 2262 (2005).
12. B. T. Lee, K. H. Kim and J. K. Han, *J. Mater. Res.*, **19**, 3234 (2004).
13. B. T. Lee, D. H. Jang, I. C. Kang and C. W. Lee, *J. Am. Ceram. Soc.*, (2005) in press.
14. B. T. Lee and H. D. Kim, *Mater. Trans. JIM*, **37**, 1547 (1996).
15. J. F. Li, S. Satomi, R. Watanabe, M. Omori and T. Hirai, *J. Eur. Ceram. Soc.*, **20**, 1795 (2000).